

プロセスガス用 圧力センサ

集積型ガスパネル用  
SUS316Lダイヤフラム

Model: **HYPFZW**

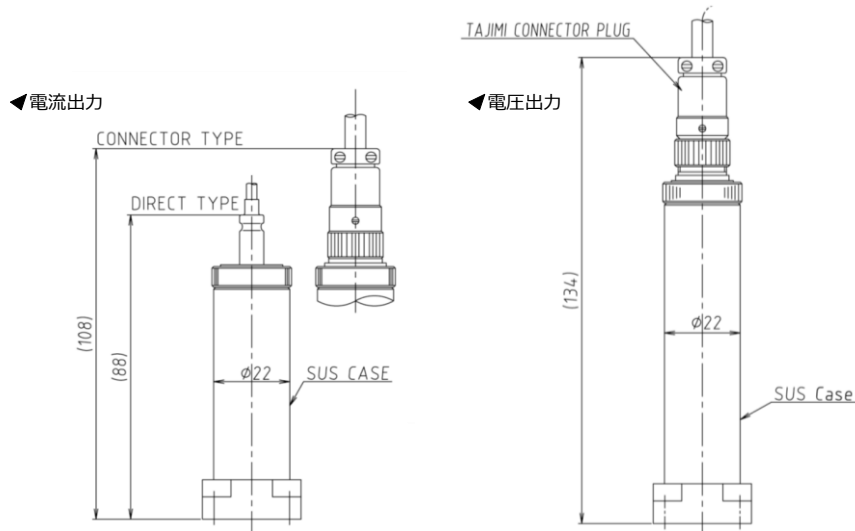
**Tem-Tech Lab.**



- ✓ アジアの半導体工場でIGS圧力センサーの標準部品
- ✓ 接ガス部全てがSUS316Lの高耐食圧力センサー
- ✓ 集積型Cシール、Wシールほか各社シールでの販売実績

- 圧力損失の少ない構造で優れた置換特性
- ゲージ圧、連成圧ともに製作可能
- 独自の荷重変換型ダイヤフラム構造により高性能を実現
- 標準の伝送信号は国際規格の2線式4-20mA \* 電圧出力も可能です
- 表示器一体型の製作も可能
- 封入液のないドライセンサー

**Tem-Tech Lab.**



測定流体	半導体プロセスガス	
接ガス部材質	ダイヤフラム: SUS316L (VIM + VAR) センサーボディ: SUS316L	
測定範囲	0 (-0.1) - 0.3、0.5、1MPa その他ご指定	
許容限度圧力	定格圧力×2倍	
電源電圧	DC24V±10%	DC15~24V
出力信号	4~20mADC (2線式)	0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC (3線式)
総合精度	±0.5%FS (直線性・ヒステリシス・再現性含む)	
温度補償範囲	0~60℃ (氷結、結露無きこと)	
動作温度範囲	0~80℃ (氷結、結露無きこと)	
温度特性	±0.05%FS/℃ (温度補償範囲内)	
保護等級	IP55相当 ※屋内仕様	
取付けネジ	Cシール、 Wシール	
ネジサイズ	1.125" 1.5" (その他ご相談ください)	
ケーブル取出し	着脱式多治見コネクタ	
付属ケーブル	3m 標準 (2芯+シールド線)	3m 標準 (3芯+シールド線)
シール方法	特殊電子ビーム溶接	
リーク量	<math>< 5 \times 10^{-12}</math>Pam <sup>3</sup> /sec	
内面仕上げ度	Ra: <math>< 0.25</math>μm以下	

## ◀ 型式構成標準型式例 : HYPFZW-420TS2

型式	シール種類		-	アナログ出力		信号コネクタ		継手サイズ	
HYPFZ	I	Cシール		420	4-20mA	P	直結ケーブル	S1	1.5"
	W	Wシール		105	1-5V	T	ネジ式コネクタ (多治見)	S2	1.125"
		010		0-10V	M	ソケットコネクタ (モレックス)	S3	3/8"	
		005		0-5V					

## Tem-Tech Lab.

株式会社 テムテック研究所

本社 : 〒104-0052 東京都中央区月島 2-7-13

TEL:03-3534-5320 (代表)

FAX:03-3534-5322

大阪営業所 : 〒582-0026 大阪府柏原市旭ヶ丘2-14-27 #104号

TEL:080-5705-9270

URL: <https://www.tem-tech.co.jp> Email: [sales@tem-tech.co.jp](mailto:sales@tem-tech.co.jp) (代表)